

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第7部門第2区分  
 【発行日】平成27年2月5日(2015.2.5)

【公表番号】特表2014-501442(P2014-501442A)  
 【公表日】平成26年1月20日(2014.1.20)  
 【年通号数】公開・登録公報2014-003  
 【出願番号】特願2013-543728(P2013-543728)  
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/027 (2006.01)

H 0 1 J 37/305 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/30 5 4 1 G

H 0 1 J 37/305 B

【手続補正書】

【提出日】平成26年12月12日(2014.12.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

真空チャンバと、

基板をパターニングするために前記真空チャンバ中に配置されたリソグラフィ装置(301)と、

点検目的のために前記真空チャンバに入ることを可能にするドア(330)とを具備するリソグラフィシステムユニットであって、

リソグラフィシステムユニットの前記ドアは、このリソグラフィシステムユニットの一側面で自由領域に面しており、前記ドアには、前記基板を処理する少なくとも1つの構成要素が設けられ、

前記ドアには、前記真空チャンバに、及び前記真空チャンバから基板を搬送するロードロックシステム(310)が設けられているリソグラフィシステムユニット。

【請求項2】

前記ドアは、前記真空チャンバに取り外し可能に接続されている請求項1のリソグラフィシステムユニット。

【請求項3】

前記ドアには、少なくとも1つの搬送要素(345)が設けられている請求項2のリソグラフィシステムユニット。

【請求項4】

基板の一時的な保管用の保管ユニット(410)を有する請求項1ないし3のいずれか1のリソグラフィシステムユニット。

【請求項5】

リソグラフィ装置(301)でパターニングする基板を準備する準備システム(320)をさらに具備する請求項1ないし4のいずれか1のリソグラフィシステムユニット。

【請求項6】

前記準備システムと前記ロードロックシステムとの間で基板を搬送するロボット(401, 501)をさらに具備する請求項5のリソグラフィシステムユニット。

【請求項7】

前記準備システムは、クランプを形成するように、基板支持構造体(403)に基板(405)をクランプするクランプユニット(360)を有する請求項5又は6のリソグラフィシステムユニット。

【請求項8】

請求項1ないし7のいずれか1の複数のリソグラフィシステムユニットを具備するリソグラフィシステム。

【請求項9】

前記リソグラフィシステムユニットは、背中合わせで2列に配置されている請求項8のリソグラフィシステム。

【請求項10】

前記複数のリソグラフィシステムユニットへの基板の供給を可能にする基板供給システム(315)と、

前記基板供給システムと前記複数のリソグラフィシステムユニットとの間で基板を搬送する基板搬送システム(350, 350')とをさらに具備する請求項8又は9のリソグラフィシステム。

【請求項11】

各リソグラフィシステムユニットは、  
準備システムと、

前記基板搬送システムと前記準備システムとの間で基板を搬送するロボットとを有する請求項10のシステム。

【請求項12】

リソグラフィ装置(301)でパターニングする基板を準備する準備システム(320)をさらに具備する請求項8ないし10のいずれか1のシステム。

【請求項13】

複数のリソグラフィシステムユニットを具備するリソグラフィシステム(300)であって、

各リソグラフィシステムユニットは、  
真空チャンバと、

基板をパターニングするために真空チャンバ中に配置されたリソグラフィ装置(301)と、

前記真空チャンバに、及び前記真空チャンバから基板を搬送するロードロックシステム(310)と、

点検目的のために前記真空チャンバに入ることを可能にするドア(330)とを具備し、

各リソグラフィシステムユニットの前記ロードロックシステム及び前記ドアは、このリソグラフィシステムユニットの同じ側面に設けられ、このリソグラフィシステムの一側面で自由領域に面しているリソグラフィシステム。

【請求項14】

前記リソグラフィシステムユニットは、背中合わせで2列に配置されている請求項13のリソグラフィシステム。